

-
- 1 中央研究院院士杜經寧教授專訪
蔡佳龍；林祐仲

 
- 2 電漿子學原理與應用
洪健雄(Jian-Shiung Hong)；何拓利(Anatoliy V Goncharenko)；周榮華(Rone-Hwa Chou)；陳寬任(Kuan-Ren Chen)
電漿子學；表面電漿子；電磁波；次波長；奈米結構；奈米光學；Plasmonics；Surface Plasmon；Electromagnetic Wave；Subwavelength；Nanostructure；Nanophotonics
預覽摘要 | 被引用次數(2)

 
- 3 電漿製程中電漿密度之量測—傳輸線式微波干涉儀
謝政宏(C. H. Hsieh)；張家豪(C. H. Chang)；鄭景元(J. Y. Jeng)；柳克強(K. C. Leou)
電漿製程；電漿密度；微波干涉儀；Plasma Processing；Plasma Density；Microwave Interferometer
預覽摘要 | 被引用次數(3)

 
- 4 利用電漿增強化學氣相沉積法於可撓式塑膠基材上製備有機／無機多層氣體阻障層結構
吳政洋(Cheng-Yang Wu)；廖仁懋(Ren-Mao Liao)；賴豐文(Li-Wen Lai)；鄭名訓(Ming-Shium Jeng)；劉代山(Day-Shan Liu)
電漿增強化學氣相沉積；四甲基矽烷；水氣滲透率；附著度；可撓式塑膠基板；有機矽基/氧化矽多層阻障結構；殘留應力；Plasma-enhanced Chemical Vapor Deposition；Tetramethylsilane；Water Vapor Transmission Rate；Adhesion；Flexible Plastic Substrate；Organosilicon/Silicon Oxide Multilayered Barrier Structure；Residual Stress
預覽摘要

 
- 5 以射頻磁控式共濺鍍系統製作氧化鋅基薄膜電晶體之特性研究
李欣縈(Hsin-Ying Lee)；林詠濠(Yong-Hao Lin)；謝文明(Wen-Ming Shien)；李清庭(Ching-Ting Lee)
磁控式射頻共濺鍍系統；薄膜電晶體；氧化鋅；Magnetron RF Co-sputter；Thin Film Transistors；ZnO
預覽摘要

 
- 6 柱狀金屬一介電質波導陣列之表面電漿子布拉赫振盪
藍永強(Yung-Chiang Lan)；許瑞成(Ruei-Cheng Shiu)
表面電漿子；布拉赫振盪；轉換光學；Surface Plasmons；Bloch Oscillation；Transformation Optics
預覽摘要

 
- 7 雷射電漿简介
朱旭新(Hsu-Hsin Chu)；林俊元(Jiunn-Yuan Lin)；陳賜原(Szu-Yuan Chen)；汪治平(Jyh-Pyng Wang)
被引用次數(1)

 
- 8 真空電子學之磁旋管發展
張存續(Tsun-Hsu Chang)；陳乃慶(Nai-Ching Chen)；杜朝海(Chao-Hai Du)；袁景濱(Ching-Pin Yuan)
真空電子學；電漿；磁旋管；微波管；Vacuum Electronics；Plasma；Gyrotron；Microwave Tube
預覽摘要 | 被引用次數(2)